

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第1部門第1区分
 【発行日】令和5年7月27日(2023.7.27)

【国際公開番号】WO2021/016121
 【公表番号】特表2022-541587(P2022-541587A)
 【公表日】令和4年9月26日(2022.9.26)
 【年通号数】公開公報(特許)2022-176
 【出願番号】特願2022-503902(P2022-503902)
 【国際特許分類】

10

A 2 4 F 4 0 / 4 2 (2 0 2 0 . 0 1)
 A 2 4 F 4 0 / 1 0 (2 0 2 0 . 0 1)
 A 2 4 F 4 0 / 4 4 (2 0 2 0 . 0 1)
 A 2 4 F 4 0 / 4 0 (2 0 2 0 . 0 1)

【 F I 】

A 2 4 F 4 0 / 4 2
 A 2 4 F 4 0 / 1 0
 A 2 4 F 4 0 / 4 4
 A 2 4 F 4 0 / 4 0

20

【手続補正書】
 【提出日】令和5年7月19日(2023.7.19)
 【手続補正1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項1】

30

気化器デバイス用のアダプタであって、該アダプタが、
 気化可能な材料を保持するように構成されたリザーバであって、該リザーバが、前記気化器デバイスの容器内に位置決めされ、前記気化器デバイスの加熱要素によって加熱されて、熱を前記気化可能な材料に伝達し、それによって、使用者が吸入するためのエアロゾルを生成するように構成されている、

前記リザーバの内部容積を囲む側壁と、

前記気化可能な材料を、前記加熱要素によって加熱される前記側壁に導くように構成された前記側壁の少なくとも一部に沿って位置決めされた毛管構造とを備えるリザーバと、

前記リザーバに結合された基部と

を備え、

40

前記基部は、

前記アダプタの外部に露出した外側基部表面を含む基部フロアと、

前記基部フロアの少なくとも一部を囲むように構成された基部ハウジングとを備える、アダプタ。

【請求項2】

前記毛管構造が、前記側壁の内部の少なくとも一部にわたって形成された1つ以上の通路を含む、請求項1記載のアダプタ。

【請求項3】

前記1つ以上の通路が、第1の方向と、該第1の方向に対して垂直である第2の方向とに延在し、前記側壁の前記内部の対向する部分に沿って位置決めされ、前記側壁の前記内

50

部の一部のみに沿って位置決めされており、

前記毛管構造が、前記リザーバの基部壁に沿って形成された1つ以上の通路をさらに備え、

少なくとも1つの通路が、前記側壁の前記内部の底部から前記側壁の前記内部の頂部まで延在しており

前記1つ以上の通路が、隣接する細長い棒同士および/または隣接する細長い円筒同士の間の凹部として形成されており、

前記1つ以上の通路のそれぞれが等しい深さを有する、および/または、前記1つ以上の通路が様々な深さを有する、請求項2記載のアダプタ。

【請求項4】

前記毛管構造が、1つ以上の開口を含み、前記リザーバの内部容積内に位置決めされるように構成されている、請求項1から3までのいずれか1項記載のアダプタ。

【請求項5】

前記基部フロアが基部フロアコネクタを備え、前記基部ハウジングがスロットを備え、前記基部フロアコネクタは、前記基部ハウジングを前記基部フロアに固定するために前記スロット内に位置決めされるように構成されている、請求項1から4までのいずれか1項記載のアダプタ。

【請求項6】

前記基部ハウジングが外側ハウジング表面を備え、前記外側基部表面が前記外側ハウジング表面から離隔されて入口を画定しており、前記入口は、空気が前記入口を通過して前記アダプタに流入することを可能にするように構成されている、請求項1から5までのいずれか1項記載のアダプタ。

【請求項7】

空気流経路をさらに備える、請求項1から6までのいずれか1項記載のアダプタ。

【請求項8】

前記空気流経路が前記基部と前記リザーバとの間に延在しており、前記空気流経路は、前記基部の入口と前記リザーバの出口との間において、前記アダプタの前記リザーバ内と前記基部内とに完全に位置決めされている、請求項7記載のアダプタ。

【請求項9】

前記空気流経路が、前記アダプタの内部で封止されている、請求項8記載のアダプタ。

【請求項10】

前記空気流経路が前記基部と前記リザーバとの間に延在しており、前記空気流経路は、外部開口を通過して前記基部内に延在し、該基部から、前記リザーバに設けられたリザーバ開口内に延在している、請求項7記載のアダプタ。

【請求項11】

前記リザーバを前記基部に向かって引っ張って前記リザーバと前記基部との間にシールを形成する力を提供するように構成された保持部材をさらに備える、請求項1から10までのいずれか1項記載のアダプタ。

【請求項12】

前記リザーバがリザーバ頂部とリザーバ基部とを備え、前記毛管構造が前記リザーバ基部上に位置決めされている、請求項1から11までのいずれか1項記載のアダプタ。

【請求項13】

前記リザーバがリザーバ頂部とリザーバ基部とを備え、前記毛管構造の第1の部分が前記リザーバ基部上に位置決めされており、前記毛管構造の第2の部分が前記リザーバ頂部上に位置決めされている、請求項1から11までのいずれか1項記載のアダプタ。

【請求項14】

前記リザーバの外部表面に沿って形成されている1つ以上の外部通路をさらに備え、前記1つ以上の外部通路は、前記リザーバの前記外部表面に残留している気化可能な材料を捕捉するように構成されている、請求項1から13までのいずれか1項記載のアダプタ。

【請求項15】

10

20

30

40

50

前記アダプタが前記気化器デバイスに結合されたとき、前記リザーバの第 1 の側面が前記容器に接触し、かつ、前記リザーバの反対側の第 2 の側面が前記容器から離隔する、請求項 1 から 1 4 までのいずれか 1 項記載のアダプタ。

【請求項 1 6】

前記アダプタが前記気化器デバイスに結合されたとき、前記リザーバの頂部表面が前記容器に接触している、請求項 1 から 1 5 までのいずれか 1 項記載のアダプタ。

10

20

30

40

50